

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム (IDEA) からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2014年 8月公開分 (29件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2014-140839	排ガス浄化用触媒担体及び排ガス浄化用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所 水澤化学工業株式会社
2	特開2014-140854	摩擦攪拌プロセスツール並びにこれを用いた鉄系材料の表面改質方法及び鉄系材料を一方とする接合方法	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2014-143011	イオン注入装置	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2014-143248	SiC半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2014-143320	高パワーインコヒーレント光発生装置	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2014-143403	多成分系酸化半導体の前駆体塗布液及び該塗布液を用いた多成分系酸化半導体膜の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2014-143957	自己倍数化抑制に基づく酵母の育種方法	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2014-144875	半導体薄膜結晶の製造方法および装置	独立行政法人産業技術総合研究所 コーニングホールディングジャパン合同会社
9	特開2014-145659	X線反射装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 公立大学法人首都大学東京
10	特開2014-145688	めっき液中の金属錯体定量化方法および金属錯体定量化装置	独立行政法人産業技術総合研究所 住友電工プリントサーキット株式会社
11	特開2014-146474	有機EL表示装置及びそれに用いるテープ状構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2014-146478	面状ヒータ及びこれを用いたデバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2014-146625	埋め込み電極又は配線の作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2014-146757	炭化珪素半導体装置の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2014-148433	非晶質鉄ケイ酸塩及びその合成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2014-149215	気体透過性評価装置	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2014-151303	懸濁粒子濃縮方法および装置	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2014-151425	単結晶SiC基板の表面加工方法、その製造方法及び単結晶SiC基板の表面加工用研削プレート	昭和電工株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2014-152219	燃料合成システムおよびその運転方法	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2014-152350	無電解めっき膜の密着性向上および除去方法とこれを用いたパターニング方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2014-153165	微小構造物検出装置及び方法並びに検出用ディスク	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2014-153530	光拡散状態を可逆的に変更可能な光拡散可変装置	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2014-155271	太陽光発電設備のための監視システム	株式会社日立アドバンスデジタル 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2014-157126	定点るつぼユニット	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社チノー
25	特開2014-157127	定点黒体炉	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社チノー
26	特開2014-157128	定点るつぼ及び定点黒体炉	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社チノー
27	特開2014-157473	テストデータ生成装置	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2014-157926	接合方法及び半導体モジュールの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 田中貴金属工業株式会社
29	特開2014-157996	太陽光発電装置	独立行政法人産業技術総合研究所